



デュアルタイプGCによる発生ガス分析技術

各種試験の発生ガス分析を高精度で行います。

GC-TCD、FIDを用いた高精度発生ガス分析

CN、CO₂リサイクル、水素利用、バイオマス利用の効率化など様々な分野で高性能触媒、特殊材料の開発が進められています。触媒の評価や熱処理試験などでは発生ガスの正確な分析が必要となりますが、デュアルタイプGC (GC-TCD、FID)を活用して各種混合ガスの高精度一括分析が可能です。

当社では、製鉄や環境エンジニアリング分野などにおいて、触媒反応・利用評価のための実証試験や特殊ガス雰囲気下での高温熱処理などに数多くの実績を有しております。その経験を生かして、試験・評価方法の調査や提案、試験分析及び解析を実施して、お客様の技術課題解決や開発のお手伝いをいたします。

デュアルタイプGCを活用した触媒評価試験、熱処理試験

デュアルタイプGCを活用して、各種試験で発生した混合ガス(無機ガス+有機ガス)の一括分析が可能です。各種試験装置に接続することで、発生ガスの挙動を迅速かつ高精度に一括分析できることが特徴です。



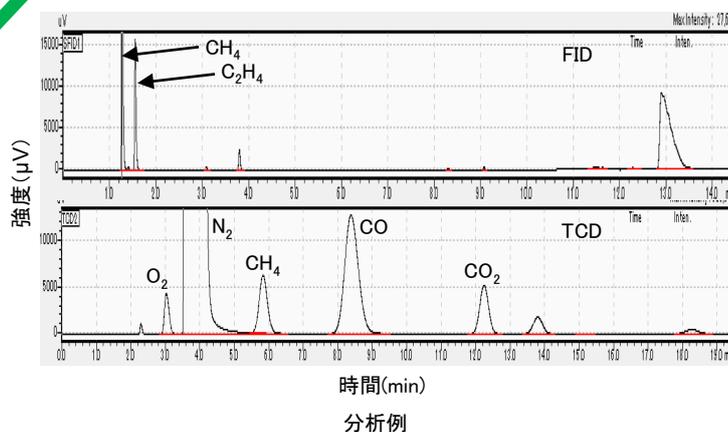
触媒評価試験装置例



デュアルタイプGC (TCD+FID)



特殊ガス雰囲気高温熱処理装置例



測定成分および測定範囲例

測定成分	測定範囲	検出器
無機ガス H ₂ 、N ₂ 、CO、CO ₂ 、CH ₄ など	0.1%～100%	TCD
有機ガス CH ₄ 、C ₂ ～C ₅ など	50ppm～10000ppm	FID

TCD(Thermal Conductivity Detector 熱伝導度型検出器) FID(Flame Ionization Detector 水素炎イオン化型検出器)

お客様のご要望に応じて最適に設計したガス流通式連続触媒反応試験装置、特殊ガス雰囲気下での高温熱処理装置などの各種試験装置と組み合わせて、炭化水素類を含む各種混合ガスの分析を行います。



JFE テクノリサーチ 株式会社

<https://www.jfe-tec.co.jp>

0120-643-777

Copyright ©2024 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。